

СОДЕРЖАНИЕ

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Потапов А. А. Концептуальные основы проектирования наносистем	2
Глухова О. Е. Тонкие углеродные тубулярные нанокластеры в однородном электростатическом поле	8

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

Дорошевич В. К. Методы статистического контроля технологического процесса изготовления микросхем и порядок их применения	13
Потягалова А. С. Общие свойства и модификации алгоритмов редукции	15

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

Спирин В. Г. Сопротивление электродов тонкопленочного резистора	19
Невешкин А. А., Русанова Т. Ю., Горин Д. А., Штыков С. Н., Климов Б. Н. Получение наноразмерных пленок каликс[4]резорцинаренов на основе сочетания методов полиионной сборки и Ленгмюра—Блоджетт	24
Вошинский Е. А., Вошинский Ю. А., Горелик В. С., Злобина Л. И., Самойлович М. И., Свербиль П. П. Спектры пропускания искусственных опалов, пропитанных жидкостью	27
Теплова Т. Б. Физико-технологические принципы получения нанометрового рельефа поверхности при обработке твердых хрупких материалов электронной техники	33

ПРИМЕНЕНИЕ МНСТ

Проснянюк В. В., Сигейкин Г. И., Суворов И. С., Колединский Г. М. Миниатюрные резервные источники тока на основе энергонасыщенных конденсированных систем.	37
--	----

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

Белозубов Е. М., Белозубова Н. Е. Повышение термостойкости тонкопленочных емкостных МЭМС-структур	41
Матвеев В. В., Распопов В. Я. Выбор ориентации топологии микрогирскопа на пластине монокристаллического кремния	44
Григорьев Ю. А., Шалаев П. Д., Бурцев А. А., Пименов В. Г., Рехен Г. А. Исследование вакуумных автоэмиссионных микродиодов с изменяющимся зазором	47

ИНФОРМАЦИЯ

Раткин Л. С. Наноиндустрия — вакуумной технике	52
Contents	55